

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和1年7月25日(2019.7.25)

【公表番号】特表2017-506770(P2017-506770A)

【公表日】平成29年3月9日(2017.3.9)

【年通号数】公開・登録公報2017-010

【出願番号】特願2016-567142(P2016-567142)

【国際特許分類】

G 02 B 26/06 (2006.01)

【F I】

G 02 B 26/06

【誤訳訂正書】

【提出日】令和1年6月19日(2019.6.19)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

各反射光学素子(102, 104)が光放射(108)を複数回反射するように、マルチパスキャビティ(106)を規定する少なくとも2つの前記反射光学素子(102, 104)を備えた、前記光放射(108)を処理するための装置(100; 200)において、

前記装置が、補正素子と呼ばれる少なくとも1つの素子を備え、前記少なくとも1つの補正素子が複数の補正位置(116)を提示し、前記少なくとも1つの補正素子の各々が、前記光放射の反射または透過を生成し、不均一な表面を有し、それによって前記補正位置(116)の空間位相プロファイルは、前記補正位置(116)のいくつかの異なる反射/透過地点について異なる位相シフトを有し、そして、前記補正位置(116)のうちの少なくとも2つが異なる位相プロファイルを有し、

前記補正素子が：

前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子の1つ、および/または、

前記マルチパスキャビティに配置され、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子と異なる補正素子を備え、

ここで、前記装置(100; 200)が、

- 前記光放射(108)を異なる反射位置で少なくとも4回反射させるために各反射光学素子(102, 104)が配置されることを目的として、前記光放射(108)を2つの反射光学素子(102, 104)との間で複数回行ったり来たりするようにマルチパスキャビティ(106)が配置されており、

- 前記反射光学素子の一方(102)が、湾曲した反射面(114)を備え、

前記マルチパスキャビティを規定する前記少なくとも1つの反射素子(104)が、スルーホールを備え、前記スルーホールにより、処理される前記放射を前記マルチパスキャビティに導入し、及び/又は処理後に前記マルチパスキャビティから出力することを可能にする

ことを特徴とする、装置。

【請求項2】

前記少なくとも1つの補正光学素子が、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射

光学素子の 1 つであることを特徴とする、請求項 1 に記載の装置 (1 0 0 ; 2 0 0) 。

【請求項 3】

前記装置が、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子にそれぞれ対応する少なくとも 2 つの補正素子を備えていることを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の装置。

【請求項 4】

前記少なくとも 1 つの補正素子が、前記マルチパスキャビティ内に配置され、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子と異なることを特徴とする、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 5】

前記補正位置のうちの少なくとも 2 つが同じ位相プロファイルを有することを特徴とする、請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 6】

前記少なくとも 1 つの補正光学素子 (1 0 2) が、少なくとも 1 つの補正位置 (1 1 6) のレベルで、少なくとも 1 つの位相板を備えていることを特徴とする、請求項 1 から 5 のいずれか一項に記載の装置 (1 0 0 ; 2 0 0) 。

【請求項 7】

前記少なくとも 1 つの補正素子 (1 0 2) が、少なくとも 2 つの補正位置 (1 1 6) について少なくとも 2 つの空間位相プロファイルを有する单一の位相板を備えていることを特徴とする、請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 8】

前記マルチパスキャビティ (1 0 6) を規定する前記反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) が、互いに直交する 2 つの方向 (2 0 2 , 2 0 4) に配置され、前記装置 (2 0 0) はまた、前記反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) のそれぞれの前記方向 (2 0 2 , 2 0 4) に対して 45° の角度で前記反射光学素子 (1 0 2 , 1 0 4) に対向して配置されているミラー (2 0 6) を備えていることを特徴とする、請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の装置 (2 0 0) 。

【請求項 9】

前記マルチパスキャビティを規定する前記少なくとも 1 つの反射素子 (1 0 4) が、スルーホールを備え、前記スルーホールによって、処理すべき前記光放射を前記マルチパスキャビティに導入することを可能にするか、及び / 又は、処理後に前記マルチパスキャビティから出力することを可能にすることを特徴とする、請求項 1 に記載の装置 (2 0 0) 。

【請求項 10】

前記反射光学素子の他方 (1 0 2) が平坦な反射面 (1 1 2) を備える、請求項 1 に記載の装置 (2 0 0) 。

【請求項 11】

伝播の連続により光放射 (1 0 8) を処理するためのシステムであって、前記システムが、

請求項 1 から 9 のいずれか一項に記載の補正装置 (1 0 0 , 2 0 0) 、
前記光放射 (1 0 8) を前記補正装置内に導入するための手段、および、
前記補正装置の出口で前記光放射 (1 0 8) を収集するための手段
を備えている、システム。